МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Микро- и наноэлектроника»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.В.ДВ.05.01 « Неупорядоченные полупроводники»

Направление подготовки 03.03.01 «Прикладные математика и физика»

Направленность (профиль) подготовки Электроника, квантовые системы и нанотехнологии

> Уровень подготовки Академический бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Формы обучения – очная

Оценочные материалы — это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача — обеспечить оценку уровня общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

- ПК-1.1 проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
 - ПК-2.1 анализирует научные данные, результаты экспериментов и наблюдений;
- ПК-3.1 проводит контроль электрических параметров активной части схемы и трассировки коммутационных плат изделий "система в корпусе";
- ПК-3.2 проводит проверку электрических параметров интегральных электронных схем, изделий "система в корпусе" на соответствие требованиям технического задания.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях и самостоятельных работах. При оценивании результатов освоения практических занятий и самостоятельной работы применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Количество практических работ и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой. Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением теоретического зачета. Форма проведения зачета — устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включается два теоретических вопроса. В процессе подготовки к устному ответу экзаменуемый должен составить в письменном виде план ответа, включающий в себя определения, выводы формул, рисунки, схемы и т.п.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

| № п / п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Введение | ПК-1.1, ПК-2.1 | зачет |
| 2 | Микроскопические и термодинамические аспекты классификации неупорядоченных систем | ПК-1.1, ПК-2.1 | практические занятия, зачет |

| 3 | Атомная структура неупорядоченных | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-3.1, | практические |
|---|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | систем | ПК-3.2 | занятия, зачет |
| 4 | Электронные состояния, оптические | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-3.1, | практические |
| | свойства и транспорт носителей в | ПК-3.2 | занятия, зачет |
| | неупорядоченных полупроводниках | | |
| 5 | Технологические методы | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-3.1, | практические |
| | получения неупорядоченных | ПК-3.2 | занятия, зачет |
| | полупроводников | | |
| 6 | Способы управления | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-3.1, | практические |
| | свойствами неупорядоченных | ПК-3.2 | занятия, зачет |
| | полупроводников | | |
| 7 | Контактные и поверхностные явления | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-3.1, | практические |
| | в структурах на основе | ПК-3.2 | занятия, зачет |
| | неупорядоченных полупроводников | | |
| 8 | Приборы и устройства на основе | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-3.1, | практические |
| | неупорядоченных полупроводников | ПК-3.2 | занятия, зачет |

Формы текущего контроля

Текущий контроль по дисциплине «Неупорядоченные полупроводники» проводится в виде экспресс — опросов и заданий по отдельным темам дисциплины, проверки заданий, выполняемых самостоятельно и на практических занятиях. Учебные пособия по дисциплине «Неупорядоченные полупроводники», рекомендуемые для самостоятельной работы обучающихся, содержат необходимый теоретический материал и вопросы по каждому из разделов дисциплины. Результаты ответов на вопросы тестовых заданий контролируются преподавателем.

Формы промежуточного контроля

Формой промежуточного контроля по дисциплине является теоретический зачет. К зачету допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом и настоящей программой. Форма проведения зачета – устный ответ, по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины.

Критерии оценки компетенций обучающихся и шкалы оценивания

Формирование у обучающихся во время обучения в семестре указанных выше компетенций на этапах лабораторных занятий, а также самостоятельной работы оценивается по критериям шкалы оценок: «зачтено» — «не зачтено». Освоение материала дисциплины и контролируемых компетенций обучающегося служит основанием для допуска обучающегося к этапу промежуточной аттестации — теоретическому зачету.

Целью проведения промежуточной аттестации (зачета) является проверка общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных студентом при изучении дисциплины «Неупорядоченные полупроводники».

Уровень теоретической подготовки определяется составом приобретенных компетенций, усвоенных им теоретических знаний и методов, а также умением осознанно, эффективно использовать их при решении задач целенаправленного применения некристаллических. неупорядоченных материалов для изделий современной электроники.

Теоретический зачет организуется и осуществляется, как правило, в форме собеседования. Средством, определяющим содержание собеседования студента с экзаменатором, являются экзаменационный билет, содержание которого определяется ОПОП и Рабочей программой. Экзаменационный билет включает в себя, как правило, два вопроса, один из которых относятся к указанным выше теоретическим разделам дисциплины и один – практическому применению неупорядоченных полупроводников в электронной технике.

Оценке на заключительной стадии теоретического зачета подвергаются устные ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора по критериям шкалы оценок: «зачтено» – «не зачтено».

Применяются следующие критерии оценивания компетенций (результатов):

- уровень усвоения материала, предусмотренного программой;
- умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи;
- полнота, аргументированность, убежденность ответов на вопросы;
- качество ответа (общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция);
- использование дополнительной литературы при подготовке к этапу промежуточной аттестации.

К оценке уровня знаний и практических умений и навыков рекомендуется предъявлять следующие общие требования.

Оценка «Зачтено» выставляется обучающемуся, который показывает полные или достаточно полные и твёрдые знания программного материала дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов); правильно, аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров; владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данной дисциплины, других изучаемых предметов; делает несущественные ошибки в ответах на дополнительные вопросы.

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая активная работа на практических занятиях.

Оценка «**Не зачтено**» выставляется обучающемуся, который демонстрирует отсутствие знаний значительной части программного материала дисциплины (не справился с 50% вопросов и заданий при ответе на вопросы билета), в ответах на дополнительные вопросы допускает существенные и грубые ошибки. Целостного представления о взаимосвязях элементов дисциплины «Неупорядоченные полупроводники» и использования предметной терминологии у обучающегося нет.

Типовые контрольные темы практических занятий и вопросы по дисциплине «Неупорядоченные полупроводники»

Примерные темы практических занятий

| | примерные темы практических занятии | | | |
|---|--|--|--|--|
| № | Наименование темы | | | |
| 1 | Микроскопические и термодинамические аспекты классификации неупорядоченных систем. Атомная структура неупорядоченных систем. | | | |
| 2 | Особенности атомной структуры неупорядоченных систем | | | |
| 3 | Электронные состояния, оптические свойства и транспорт носителей в неупорядоченных полупроводниках | | | |
| 4 | Технологические методы получения объемных и пленочных неупорядоченных полупроводников | | | |
| 5 | Особенности управления свойствами неупорядоченных полупроводников | | | |
| 6 | Контактные и поверхностные явления в структурах на основе неупорядоченных полупроводников | | | |
| 7 | Электронные приборы и устройства на основе неупорядоченных полупроводников | | | |
| 8 | Оптоэлектронные приборы и устройства на основе неупорядоченных полупроводников | | | |

Вопросы к теоретическому зачету

Тема 1 «Введение

| 1.1 | Hotomya monyaya Ayoyyay yayyangaayayyyy ya ayyanna ayyyan n Docoyy y oo ayyayyay | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | История развития физики неупорядоченных полупроводников в России и за рубежом | | | | |
| 1.2 | Определение и критерии неупорядоченного материала. | | | | |
| Tema 2 «Микроскопические и термодинамические аспекты классификации | | | | | |
| | орядоченных систем» | | | | |
| 2.1 | Виды неупорядоченных систем. Случайные и неслучайные отклонения в | | | | |
| 2.2 | потенциальной энергии носителей | | | | |
| 2.2 | Способы классификации неупорядоченных систем | | | | |
| 2.3 | Термодинамические уровни описания стабильности | | | | |
| 2.4 | Классификация метастабильных состояний | | | | |
| 2.5 | Аморфные и стеклообразные состояния | | | | |
| 2.1 | Тема 3 «Атомная структура неупорядоченных систем» | | | | |
| 3.1 | Понятие ближнего, среднего и дальнего порядка в расположении атомов | | | | |
| 3.2 | Микрокристаллическая модель строения некристаллического материала. | | | | |
| 3.3 | Модель аморфной сетки | | | | |
| 3.4 | Методы исследования структуры неупорядоченных полупроводников | | | | |
| | Тема 4 «Электронные состояния, оптические свойства и транспорт носителей в | | | | |
| • | орядоченных полупроводниках» | | | | |
| 4.1 | Локализованные электронные состояния | | | | |
| 4.2 | Особенности структуры и модели энергетических зон в неупорядоченных | | | | |
| 4.0 | полупроводниках | | | | |
| 4.3 | Собственные свойства неупорядоченных полупроводников различных классов | | | | |
| 4.4 | Электрофизические свойства неупорядоченных полупроводников. Механизмы | | | | |
| 4.7 | электропроводности | | | | |
| 4.5 | Электрофизические свойства неупорядоченных полупроводников. ТермоЭДС и | | | | |
| 4.5 | коэффициент Холла. | | | | |
| 4.6 | Край поглощения и фотопроводимость в неупорядоченных полупроводниках | | | | |
| <i>r</i> 1 | Тема 5 «Технологические методы получения неупорядоченных полупроводников» | | | | |
| 5.1 | Анализ существующих методов получения аморфных слоев сложного состава | | | | |
| 5.2 | Применение лазерного излучения и плазменных ускорителей для получения аморфных | | | | |
| 5 0 | пленок | | | | |
| 5.3 | Амортизация кристаллических тел путем воздействия высокоэнергетических | | | | |
| <i>-</i> 1 | излучений | | | | |
| 5.4 | Технологические особенности получения стекловидных пленок из ХСП | | | | |
| 5.5 | Технологические особенности получения аморфных пленок их ХСП | | | | |
| 5.6 | Получение аморфных твердых материалов из растворов. Стекла, полученные | | | | |
| - 7 | гомогенным осаждением гелей. Аморфные металлы | | | | |
| 5.7 | Синтез стеклообразных полупроводников | | | | |
| 5.8 | Синтез α-Si:Н методом тлеющего разряда | | | | |
| 5.9 | Химическое осаждение из газовой фазы | | | | |
| 5.10 | Другие методы осаждения пленок α-Si:H | | | | |
| <i>c</i> 1 | Тема 6 «Способы управления свойствами неупорядоченных полупроводников» | | | | |
| 6.1 | Фотоиндуцированное изменение свойств стеклообразных полупроводников | | | | |
| 6.2 | Введение добавок в процессе синтеза неупорядоченных материалов | | | | |
| 6.3 | Влияние легирования на структуру и содержание водорода в α-Si:Н | | | | |
| 6.4 | Влияние легирования на проводимость и оптического поглощения в α-Si:H | | | | |
| 6.5 | Метастабильные процессы в α-Si:Н и проблемы управления их свойствами | | | | |
| 6.6 | Инверсия знака основных носителей заряда в халькогенидных стеклообразных | | | | |
| | полупроводниках | | | | |
| 6.7 | Модификация аморфных пленок | | | | |
| 6.8 | Легирование расплавов | | | | |
| 6.9 | Структурная модификация свойств неупорядоченных полупроводников | | | | |

| | Тема 7 «Контактные и поверхностные явления в структурах на основе | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| неупорядоченных полупроводников» | | | | | | |
| 7.1 | Потенциальные барьеры в неупорядоченных полупроводниках | | | | | |
| 7.2 | Размерные ограничения в барьерных структурах на неупорядоченных | | | | | |
| | полупроводниках | | | | | |
| 7.3 | Особенности токопрохождения в барьерных слоях на неупорядоченных | | | | | |
| | полупроводниках | | | | | |
| 7.4 | Электрофизические характеристики потенциальных барьеров на неупорядоченных | | | | | |
| | полупроводниках | | | | | |
| 7.5 | Основные методы исследования барьеров на неупорядоченных полупроводниках | | | | | |
| | Тема 8 «Приборы и устройства на основе неупорядоченных полупроводников» | | | | | |
| 8.1 | Эффект переключения в неупорядоченных полупроводниках | | | | | |
| 8.2 | | | | | | |
| | ВАХ, структурно-фазовые переходы) | | | | | |
| 8.3 | ВАХ для образца полупроводника, в котором формируется шнур тока | | | | | |
| 8.4 | Конструкторско-технологические особенности создания переключающих элементов | | | | | |
| 8.5 | Конструкция трехуровневого пленочного элемента памяти | | | | | |
| 8.6 | Классификация систем оптической записи информации | | | | | |
| 8.7 | Особенности фотостимулированных изменений скорости растворения пленок ХСП | | | | | |
| 8.8 | Схема электрофотографического процесса | | | | | |
| 8.9 | Фотоэлектрические преобразователи на основе α-Si:Н | | | | | |
| 8.10 | Тонкопленочные транзисторы на основе α-Si:H | | | | | |
| 8.11 | Фотоэлектрические преобразователи на основе α-Si:Н | | | | | |
| 8.12 | Конструкции солнечных элементов на основе α-Si:Н | | | | | |
| | Тема 9 «Заключение» | | | | | |
| 9.1 | Перспективы развитие электроники на неупорядоченных материалах | | | | | |

Составил

к.т.н., доцент кафедры микро- и наноэлектроники

Вишняков Н.В.

Зав. кафедрой микро- и наноэлектроники д.ф.-м.н., доцент

Литвинов В.Г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Простая подпись

18.07.25 17:21 (MSK)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СОГЛАСОВАНО **ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,** Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ